PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-104960

(43)Date of publication of application: 17.04.2001

(51)Int.CI.

C02F 1/469 B01D 61/48

C02F 1/42

(21)Application number: 11-287044

(71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

07.10.1999

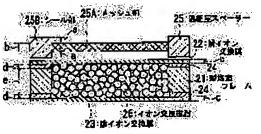
(72)Inventor: IWASAKI KUNIHIRO

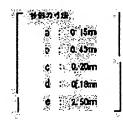
(54) ELECTRIC DEIONIZING APPARATUS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably and certainly obtain treated water of high quality by improving the packed state of an ion exchanger in the desalting chamber of an electric deionizing apparatus.

SOLUTION: The desalting chamber of an electric deionizing apparatus is packed with an ion exchanger so that the volume of the ion exchanger at a time of the passage of water becomes 101-120% of the volume the desalting chamber.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2001-104960

(P2001-104960A)

(43)公開日 平成13年4月17日(2001.4.17)

(51) Int.CL'		織別配号	FI		5	·-73-/*(参考)
C02F	1/469		B01D	61/48		4D006
B01D	61/48		C02F	1/42	ZABA	4D025
C 0 2 P	1/42	ZAB		1/46	103	4D061

審査請求 京請求 菌泉項の数2 OL (全 5 頁)

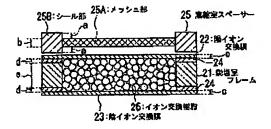
(21)山壤番号	特麼平11-287044	(71)出原人 000001063 祭田工業株式会社
(22)出籍日	平成11年10月7日(1999, 10.7)	東京都衛官区西新宿 3 丁目 4 番 7 号 (72)発明者 岩崎 邦博 東京都衛官区西新宿三丁目 4 番 7 号 栗田 工業株式会社内 (74)代理人 100086911 非理士 皇野 剛 アターム(参考) 4D008 GAL7 HA47 KA28 WA68 MA13 WA14 PA01 PB23 PC03 4D025 AA02 AB02 BA08 BA13 BA22 BA25 BA05 DA06 4D061 DA01 DB18 EA09 EB04 EB18 EB18 FA08 GC20

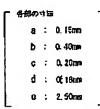
(54) 【発明の名称】 電気脱イオン装置

(57)【要約】

【課題】 電気脱イオン装置の脱塩室におけるイオン交換体の充填状態を改善することにより、高水質の処理水を安定かつ確実に得る。

【解決手段】 イオン交換体の通水時容荷が脱塩室容荷の101~120%となるように、電気脱イオン装置の脱塩室にイオン交換体を充填する。





(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陰極を備えてなる陰極室と陽極を備えてなる陽極室との間に陰イオン交換膜と陽イオン交換膜と を交互に配列して脱塩室と端縮室とを形成し、該蜗塩室 にイオン交換体を充填した電気脱イオン装置において、 該イオン交換体の通水時容積が該脱塩室容積の101~ 120%であることを特徴とする電気脱イオン装置。 【請求項2】 請求項1において、該緊塩室に充填されるイオン交換体の乾燥時容積が該脱塩室の容積の80~ 95%であることを特徴とする電気脱イオン装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、陰極と陽極との間に、複数のアニオン交換膜とカチオン交換膜とを交互に配列して濃縮室と脱塩室とを交互に形成してなる電気脱イオン装置(電気再生式脱イオン装置)に係り、特に、この電気脱イオン装置の脱塩室に充填するイオン交換体の充填密度を改善して、得られる脱イオン水の水質を高めた電気脱イオン装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体製造工場、液晶製造工場、製薬工業、食品工業、電力工業等の各種の産業ないし研究施設等において使用される脱イオン水の製造には、イオン交換制脂のような再生を必要とせず、完全な連続採水が可能で、極めて高純度の水を効率的に得ることができるという優れた特長を備えることから、電気顕イオン装置が多用されている。

【0003】電気脱イオン装置は、電便同士の間に複数のカチオン交換膜とアニオン交換膜とを交互に配列して脱塩室と濃縮室とを交互に形成し、脱塩室にイオン交換 30体を充填した構成を有する。この電気脱イオン装置にあっては陽極、陰便間に弯圧を印加しながら脱塩室に被処理水を流入させると共に、造縮室に遗瘍水を流入させ被処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造する。

【0004】図2はこの電気脱イオン装置の基本的な構成を示す分解図である。

【0005】陰極側のエンドフレート1に沿って陰極電極板2が配置され、この陰極電極板2の周珠部に特状の陰極用スペーサー3が重ね合わされる。この陰極用スペーサー3の上にカチオン交換膜4、脱塩室形成用の枠状フレーム5、アニオン交換膜6及び濃縮室形成用の枠状フレーム7がこの順に重ね合わされる。このカチオン交換膜6及び濃縮室形成用の枠状フレーム5、アニオン交換膜6及び濃縮室形成用の枠状フレーム5が1単位として多数重ね合わされる。即ち、膜4、フレーム5、 50分割のでは関係を対し枠状の陽極用スペーサー8を介して陽極電極板9が重ね合わされ、その上に陽極側エンドプレート10が重ね合わされて領層体とされる。この意愿 50

体はボルト等によって締め付けられる。

【0006】上記の脱塩室用フレーム5の内側スペースが脱塩室となっており、この脱塩室にはイオン交換樹脂等のイオン交換体5Rが充填される。また、濃縮室用フレーム7の内側スペースが濃縮室となっている。この濃縮室にはメッシュスペーサー7Mなどが配置される。

【0007】このような装置にあっては、陽極9と陰極2の間に直流電流を通じ、且つ彼処理水(原水)を彼処理水流入ライン11を通じて脱塩室内に通水せしめ、また、途縮水を遺稿水流入ライン12を通じて滤縮室内に通水せしめる。脱塩室内に流入してきた彼処理水はイオン交換制脂の充填層を掩下し、その際、該彼処理水中の不純物イオンが除かれて脱イオン水となり、これが脱イオン水流出ライン13を経て流出する。

【0008】一方、濃縮室内に通水された濃縮水は濃縮 室内を流下するときに、イオン交換膜4,6を介して移 動してくる不純物イオンを受け取り、不純物イオンを濃 縮した濃縮水として濃縮水流出ライン14より流出す る。電極室にはそれぞれ導入ライン15,16及び取出 20 ライン17,18を介して電極水が流通される。

【0009】特開平10-216729号公報には、このような電気脱イオン装置において、電気抵抗を小さくして処理の安定化を図るべく、脱塩室内に充填したイオン交換体とイオン交換膜との間に0.1~20k8/cm³の圧力を発生させて、イオン交換体相互及びイオン交換体とイオン交換膜との密着性を上げることが記載されている。そして、同公報には脱塩室に充填するイオン交換体を再生型の容積より容積を減少させた形に変換し、自由状態でのイオン交換体再生型容積が脱塩室容積に対して103%~170%となる量のイオン交換体を充填することが記載されている。ただし、同公報では、通水時(使用状態)におけるイオン交換体の容積については検討されていない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特闘平10-216729号公報に記載されるように、自由状態でのイオン交換体再生型容論が脱塩室容積に対して103~170%となるようにイオン交換体を充填しても、必ずしも良好な水質の処理水が得られるわけではなく、処理の安定性の面で問題があった。

【0011】本発明は上記従来の問題点を解決し、電気脱イオン装置の脱塩室におけるイオン交換体の充填状態を改善することにより、高水質の処理水を安定かつ確実に得ることができるようにした電気脱イオン装置を提供することを目的とする。

[0012]

フレーム7が追続して繰り返し荷層される。最後のアニ 【課題を解決するための手段】本発明の電気脱イオン装 オン交換膜6に対し枠状の陽極用スペーサー8を介して 置は、陰極を備えてなる陰極室と陽極を備えてなる陽極 陽極電極複9が重ね合わされ、その上に陽極側エンドプ 室との間に、陰イオン交換膜と陽イオン交換膜とを交互 レート10が重ね合わされて荷層体とされる。この荷層 50 に配列して脱塩室と濃箱室とを形成し、該脱塩室にイオ

ン交換体を充填した電気脱イオン装置において、該イオ ン交換体の通水時容積が該脳塩室容積の101~120 %であることを特徴とする。

【0013】なお、以下において、脱塩窒に充填された イオン交換体の通水時の容積(このイオン交換体の容積 は、 道水時の脱塩室の容債に相当する。)の、 脱塩室容 祠 (この脱塩室容詞とは、イオン交換体を充填する前の 脱塩室の容誦である。) に対する割合 (百分率) を「通 水時容荷率」と称す場合がある。

と、イオン交換体同士及びイオン交換体とイオン交換膜 との接点数が増え、脱塩室内でのイオンの移動が容易に なり、処理水の比抵抗が向上する。また、このようにイ オン交換体の充填密度を高めると、遺稿室もスペーサー を介して脱塩室のイオン交換体の膨潤により圧縮される ことにより、脱塩室から濃縮室へのイオンの移動が速く なり、脱塩が円滑に進行し、このことによっても、処理 水の比抵抗が向上する。

【0015】しかし、特開平10-216729号公報 3~170%のイオン交換体を充填すると過充填となっ て脱塩室の圧力損失が増え、処理水量が低下する上に、 濃縮室スペーサーのシールが不十分となる問題があり、 処理水の比抵抗が低下する場合がある。

【0016】本発明では、通水時容積率が101~12 ()%となるように脱塩室にイオン交換体を充填するた め、比抵抗18MQ・cm以上の処理水を安定かつ確実 に得ることができる。

【りり17】とのような本発明の電気脱イオン装置は、 吸水により膨潤すると乾燥時の110~130%程度に 30 容積が大きくなるようなイオン交換体を用い、このイオ ン交換体を乾燥状態で、脱塩室の容積に対して80~9 5%(以下、この割合を「乾燥充填率」と称す場合があ る。)となるように、脱塩室に充填して通水時容積率が 101~120%、好ましくは110%程度となるよう にして作製するのが好ましい。

[0018]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を詳細 に説明する。

【① 0 1 9 】本発明の電気脱イオン鉄圏は、通水時容積 40 率が101~120%となるように脱塩室にイオン交換 体を充填すること以外は、 図2 に示す一般的な電気脱イ オン装置と同様の構成とされている。

【0020】この通水時容積率が101%未満では、イ オン交換体の充填量が不足して十分に比抵抗の高い処理 水を得ることができない。 通水時容積率が120%を超 えるとイオン交換体の充填量が多過ぎて、濃縮室スペー サーのシールが不十分となり、やはり処理水の比越杭が 低下する。従って、通水時容請率は101~120%、

うに充填するのが好ましい。

【0021】とのような電気脱イオン装置を作製するに は、吸水により膨潤すると乾燥時の110~130%程 度に容積が大きくなるようなイオン交換体を用い、この イオン交換体を脱塩室に乾燥充填率8()~95%となる ように充填し、道水時の膨潤状態において通水時容積率 が101~120%となるようにするのが好ましい。

【0022】とのような充填率で脱塩室にイオン交換体 を充填すると、電気脱イオン装置の通水使用時にはイオ 【①①14】脱塩室のイオン交換体の充填密度を高める 10 ン交換体の吸水による膨潤で脱塩室を仕切るイオン交換 膜は遺植室側に膨らんで、脱塩室はイオン交換体充填前 の厚みよりも厚みが増すことになるが、この厚みの増加 登は、各ヶ濃縮室側に0.1~1.0mm、台計で0. 2~2. 0 mm程度であることが好ましい。

【0023】なお、脱塩室に充填するイオン交換体とし ては、イオン交換樹脂、イオン交換機能等を用いること ができ、その充填方法には特に制限はなく、富法に従っ て行うことができる。例えば、イオン交換樹脂をメタノ ール洗浄し、真空乾燥機にかけて乾燥後、乾燥樹脂を脱 に記載されるように自由状態で脱塩室容詞に対して10 20 塩室に収納して電気脱イオン装置を組み立て、その後通 水して樹脂に水分を吸収させて膨潤させる方法を採用す るととができる。

[0024]

【実能例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をよ り具体的に説明する。

【0025】実施例1

イオン交換制脂として、ダウケミカル社製モノスフィア (650C、550A)を用い、陽イオン交換樹脂/陰 イオン交換創脂=40/60 (湿潤状態での容積比)で 混合したものを、まず、10%食塩水に浸漬して塩型に 変換した後、メタノールに浸漬して水分を溶媒置換し、 これを真空乾燥機に入れて約1.5torrで2~3時 間乾燥後、デンケーター中に保管した。

【0026】この乾燥樹脂は吸水により膨瀕して乾燥時 の容積に比べて129%となるものである。この樹脂を 用いて図1に示す寸法の緊塩室及び遺稿室を有する電気 脱イオン装置を製作した。

【0027】電気脱イオン鉄置の組み立てに当っては、 まず、脱塩室フレーム21の両側に両面テープ24を貼 り、陽イオン交換膜22を貼り、次に乾燥状態のイオン 交換樹脂26を充鎮し、次に陰イオン交換膜23を貼っ て脱塩室の構成単位を作製した。この脱塩室の構成単位 3枚と濃縮室スペーサー25(シール部25Bに取り付 けられたメッシュ部25Aは20メッシュ)2枚を交互 に重ねて150kgf・cmのトルクで締め付けて電気 脱イオン装置を作製し、脱塩度及び濃縮度に導電率8μ s/cmの水を10分間供給してイオン交換額脂を十分 に温潤化させて膨稠させた。

【0028】各部材の寸法は図1に示す通りであり、脱 特に105~115%、とりわけ110%程度となるよ 59 塩室の容積は665mm×(2.5+0.18+0.1

8) mm×28mm×4リブ=213 ccである。 【りり29】この脱塩室に乾燥したイオン交換樹脂を1 92 c c 充填した。従って、乾燥充填率は90% (= 1 92÷213×100) である。

【①030】脱塩室は通水時においては、樹脂の膨潤で 両側の議縮室側へイオン交換膜が膨らんで厚みが増え る。との通水時のイオン交換体の容積に相当する通水時 の脱塩室の容積を調べるために、電気脱イオン装置の通 水後の解体の際に、樹脂を取り出す前に両側のイオン交 換膜が膨らんでいる状態で脱塩室厚さ(両側のイオン交 10 換膜を含む)をノギスで実測し、脱塩室の厚さをノギス の実測値から両イオン交換膜の厚さを差し引いて求め た。その結果、イオン交換機にはシワがよっている部分 もあったが、ノギスの実測値は平均で3.6mmであ り、脱塩室の厚さは3.2mm(3.6-(0.2+ (). 2)) であるとされた。従って、 通水時の脱塩室の*

*容績は、238cc (=665mm×3. 2mm×28 mm×4リブ) であると考えられる。

【0031】従って、通水時容績率は112%(=23 8+213×100) である。

6

【0032】この電気脱イオン装置に導電率8μs/c m. シリカ284ppb、pH7の水を電圧8. 4V, 電流(). 45Aの条件で通水して脱塩処理を行った。

【0033】このときの処理水量及び脱塩室の圧力損失 と、得られた処理水の水質は衰1に示す通りであった。 【0034】実施例2,3.比較例1.2

乾燥充填率を変え、通水時容積率を表しに示す値とした こと以外は実施例1と同様にして電気脱イオン装置を組 み立て、同様に脱塩処理を行って、得られた処理水の水 質を表1に示した。

[0035]

【表1】

例		通水時 容積率 (%)	処理水量 (L/hr)	税当室の 圧力損失 (kg/cm²)	処理水水質	
					比据统 (MΩ·¢m)	シリカ (npb)※
実施例	1	112	40	0. 4	17. 93	6 (97. 9)
	2	105	40	0. 4	17. 20	6 (97. 9)
	3	115	40	C. 35	17. 77	6 (97. 9)
比较例	1	100	40	G. 45	15	13 (95. 4)
	2	130	40	0, 6	5	45 (84. 2)

※カッコ内はシリカ除去率(%)

[0036]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の電気脱イオ ン装置によれば、著しく高純度の処理水を安定かつ確認 35 6 アニオン交換膜 に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】真施例で製作した電気脱イオン装置の競塩室と 濃縮室を示す断面図である。

【図2】電気脱イオン装置の一般的な構成を示す分解料 視図である。

【符号の説明】

4 カチオン交換膜

5 フレーム

5R イオン交換体

7 フレーム

7M メッシュスペーサ

21 脱塩室フレーム

22 隔イオン交換膜

23 陰イオン交換膜

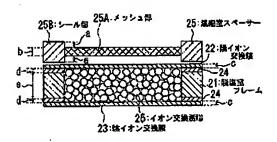
24 両面テープ

25 濃縮室スペーサー

26 イオン交換制脂

(5)





番部の寸法
 お : 0.15mm
 b : 0.40mm
 c : 0,20mm
 d : 0£18mm
 e : 2.50mm

[図2]

